(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-306976

(P2002-306976A) (43)公開日 平成14年10月22日(2002.10.22)

(51) Int.Cl. ⁷	酸別記号	FI		テーマコード(参考)
B01J	47/12 .	B01J 47	7/12 G	4 D 0 0 6
B01D	61/48	B01D 61	1/48	4 D 0 6 1
B 0 1 J	47/00	В 0 1 Ј 47	7/00 A	
C 0 2 F	1/469	C 0 2 F 1	1/46 1 0 3	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特顧2001-116013(P2001-116013)	(71)出顧人	000004400
			オルガノ株式会社
(22)出願日	平成13年4月13日(2001.4.13)		東京都江東区新砂1丁目2番8号
		(72)発明者	山中 弘次
			東京都江東区新砂1丁目2番8号 オルガ
			ノ株式会社内
		(72)発明者	井上 洋
			東京都江東区新砂1丁目2番8号 オルガ
			ノ株式会社内
		(74)代理人	100098682
			弁理士 赤塚 賢次 (外1名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多孔質イオン交換体、それを用いる脱イオンモジュール及び電気式脱イオン水製造装置

(57)【要約】

【課題】 特定の連続気泡構造を有し、細孔容積や比表面積が格段に大きな多孔質イオン交換体、組み立てが容易で、簡易な構造の脱イオンモジュール及び省電力型電気式脱イオン水製造装置を提供すること。

【解決手段】 互いにつながっているマクロポアとマクロポアの壁内に平均径が1~1000μmのメソポアを有する連続気泡構造を有し、全細孔容積が1~50ml/gであり、イオン交換基が均一に分布され、イオン交換容量が0.5mg当量/g乾燥多孔質体以上である多孔質イオン交換体を両イオン交換膜の間に充填してなる脱イオンモジュール及びこれを備える省電力型電気式脱イオン水製造装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いにつながっているマクロポアとマクロポアの壁内に平均径が $1\sim1000\mu m$ のメソポアを有する連続気泡構造を有し、全細孔容積が $1\sim50ml/g$ であり、イオン交換基が均一に分布され、イオン交換容量が 0.5mg 当量/g乾燥多孔質体以上であることを特徴とする多孔質イオン交換体。

【請求項2】 前記請求項1記載の多孔質イオン交換体を、枠体の一方の側に封着されたカチオン交換膜と他方の側に封着されたアニオン交換膜で形成される内部空間に充填してなるものであって、電気式脱イオン水製造装置に使用されることを特徴とする脱イオンモジュール。

【請求項3】 前記請求項1記載の多孔質イオン交換体を、枠体の一方の側に封着されたカチオン交換膜と、該カチオン交換膜と他方の側に封着されたアニオン交換膜の間に配置された中間イオン交換膜とで形成される第1内部空間に充填し、更に、該中間イオン交換膜と他方の側に封着されたアニオン交換膜とで形成される第2内部空間に充填してなるものであって、電気式脱イオン水製造装置に使用されることを特徴とする脱イオンモジュール。

【請求項4】 前記中間イオン交換膜がアニオン交換膜であり、前記第1内部空間に充填される多孔質イオン交換体が多孔質アニオン交換体と多孔質カチオン交換体の積層体もしくは多孔質両性イオン交換体であり、前記第2内部空間に充填される多孔質イオン交換体が多孔質アニオン交換体であることを特徴とする請求項3記載の脱イオンモジュール。

【請求項5】 前記請求項2~4のいずれか1項に記載の脱イオンモジュールを備える電気式脱イオン水製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、脱イオン水を用いる半導体製造工業、製薬工業、食品工業、発電所、研究所等の各種の工業あるいは糖液、ジュース、ワイン等の製造等で利用される電気式脱イオン液製造装置に好適に使用される多孔質イオン交換体、脱イオンモジュール及び脱イオンモジュールを備える電気式脱イオン水製造装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から実用化されている電気式脱イオン水製造装置は、基本的にはカチオン交換膜とアニオン交換膜で形成される隙間に、イオン交換体としてアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂の混合イオン交換樹脂を充填して脱塩室とし、当該イオン交換樹脂に被処理水を通過させるとともに、前記両イオン交換膜を介して被処理水の流れに対して直角方向に直流電流を作用させて、両イオン交換膜の外側に流れている濃縮水中に被処理水中のイオンを電気的に排除しながら脱イオン水を製造す

るものである。このような操作によって被処理水中の不 純物イオンは電気的に除去されるので、充填したイオン 交換樹脂を薬液による再生を全く行うことなく脱イオン 水を連続的に得ることができる。

【〇〇〇3】電気式脱イオン水製造装置においては薬液 による再生は不要であるため、その運転コストは消費電 力量によって決定される。交流を直流に変換する際の整 流口スを除けば、電気式脱イオン水製造装置における消 費電力は、両電極間の直流電流×電圧で表される。ここ で、直流電流は、被処理水が含有するイオンの量、イオ ンの種類及び要求される処理水質によって決定される。 すなわち、電気式脱イオン水製造装置においては、脱塩 室でイオン交換樹脂に捕捉されたイオンを電気的泳動に よって連続的に濃縮水側に排出する必要があり、イオン を泳動せしめるに必要な一定以上の電流は、電気式脱イ オン水製造装置がその性能を正常に発揮するために必須 のものである。よって、通常の場合、電気式脱イオン水 製造装置においては、その運転条件において必要な最低 電流値を上回る一定の電流値を保持する定電流運転が行 われている。これに対して電圧は、前記両電極間の電気 抵抗によって決定され、電気式脱イオン水製造装置に用 いられるイオン交換膜やイオン交換樹脂の性能に大きく 依存する。すなわち、該電気抵抗は、両電極間に配設さ れた電極室、濃縮室及び脱塩室による電気抵抗の総和で あり、電極間距離および運転温度を一定とすれば、電極 水及び濃縮水に含有されるイオンの濃度と種類、イオン 交換膜、イオン交換樹脂の種類とそのイオン交換基の対 イオンの種類、更にイオン交換樹脂の充填方法(単床あ るいは混床)、更にこれら全ての電気抵抗構成要素の界 面における接点抵抗が影響を与えるものである。前記電 気抵抗構成要素の内、電極水および濃縮水に含有される イオンの濃度と種類は、被処理水の水質及び要求される 処理水水質によって決定されるが、その他の要素は電気 式脱イオン水製造装置に用いられるイオン交換体の性能 とその使用方法に依存する。

【0004】しかしながら、従来の電気式脱イオン水製造装置においては、脱塩モジュールに充填されるイオン交換樹脂は、従前より普及していた汎用品がそのまま流用されており、電気式脱イオン水製造装置の運転コストを低減させるべく、前記電気抵抗値の極小化に配慮されたものとはなっていない。すなわち、従来の電気式脱イオン水製造装置では、イオン交換樹脂として、一般に、スチレンとジビニルベンゼン(DVB)の共重合体に、陽イオン交換基としてはスルホン酸基(R-S03 TH+)を、陰イオン交換基としては第4級アンモニウム塩基(R-N+R1R2R3)を導入して得られた直径0.2~0.5mm程度の球状のものが充填されている。この場合、イオン交換樹脂粒子内における電流に対し、この場合、イオン交換樹脂粒子内における電流に対し、高分子ゲル内に均一旦つ密に対し、するイオン交換基を介して低抵抗で行われるのに対し、

イオン交換樹脂粒子界面においては、イオン及び電子の 移動に際し、イオンの場合には該イオンの水中の泳動距 離が、また、電子の場合には水分子間の水素結合を介し た電子伝達経路が長く、かつ球状のため粒子同士の接触 面積が小さいのでイオンの流れが該接点部に集中し、電 流伝達の阻害要因、すなわち、電気抵抗の原因となり、 イオン交換樹脂由来の電気抵抗の主要因となっている。 【〇〇〇5】また、従来の電気式脱イオン水製造装置 は、汎用のイオン交換樹脂を脱イオンモジュールに充填 するため、製作に相当の時間と労力を必要とする。特 に、脱塩室を形成する脱イオンモジュールの組立は、サ ンドイッチ状の端を接着剤を用いて複数枚積層接着しつ つ、湿潤したイオン交換樹脂を均一に充填しなければな らず、製作には相当の熟練を要し自動化しにくい。ま た、接着剤を使用しない場合でも湿潤したイオン交換樹 脂の取扱いは難しい。

【0006】これらを解決するものとして、例えば、イオン交換樹脂を結合材ポリマーを用いて結合した多孔質構造を有し、特定の水透過性を保持した多孔質イオン交換体(特開平8-252579号公報、特開平10-192716号公報等)、アニオン交換体とカチオン交換体を接着剤を用いて接合し一体的に形成し、且つ通液部と透液封止部を特定構造にした枠体やイオン交換膜が不要となる脱塩室構造体(特開2000-218137号公報)、カチオン交換膜やアニオン交換膜の表面部分において、カチオン交換膜とアニオン交換膜を接触させ、日の管略化を図ったもの(特開平11-192491号公報)等が提案されている。

【0007】しかしながら、特開平8-252579号 公報等に記載された多孔質構造体を脱イオンモジュール の充填物とする場合、前記の粒状イオン交換樹脂の均一 充填に付随する装置製作上の問題は改善される。しかし ながら、この多孔質構造体では、従来そのまま脱イオン モジュールに充填されていた粒状イオン交換樹脂を結合 材ポリマーを用いて結合して多孔質構造体となし、更に 場合によっては、結合材ポリマー部にもイオン交換基を 導入するという、多孔質構造体製造上の新たな工程を必 要としており、装置組み立て工程の簡略化に換えて、脱 イオンモジュール充填材の製造を複雑化している。更 に、この多孔質構造体では、上述の粒状イオン交換樹脂 の充填に由来する高電気抵抗の改善が十分とは言えな い。すなわち、これらの多孔質構造体では、結合ポリマ 一部分にイオン交換基が存在しないか、存在する場合で も、イオン交換樹脂部分とは結合材ポリマーの母体及び イオン交換基の構造が異なると共に、イオン交換基の存 在密度がイオン交換樹脂部分に比べて低く、全体が均質 なイオン交換体とすることは困難である。このため、上 述の充填層内のイオンや電子移動の不均一性の問題は解

決されないままであり、イオン交換体充填層の電気抵抗 の低減及び捕捉イオンの濃縮室への効率的な排出は十分 とは言えない。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来の多れ質イオン交換体は、いずれも、粒子状のイオン交換樹脂を結合材ポリマーにより結合した一体構造物であるか、多孔構造に関する具体的な記載がないものであり、高分散相乳化重合により製造されるような、互いにつながっているマクロポアとマクロポアの壁内に水の流路となるメソポアを有する連続気泡構造のものを開示したものはない。特公平4-49563号公報には高分散相乳化重合により製造され、水性酸や有機酸の吸収能力を高めた多孔質ポリマーが開示されているが、該多孔質ポリマーは膨潤や液体吸収能力が高すぎて脱イオン水の製造には適さないものである。

【0009】従って、本発明の目的は、特定の連続気泡構造を有し、細孔容積や比表面積が格段に大きな多孔質イオン交換体を提供するものである。また、本発明の他の目的は、組み立てが容易で、簡易な構造の脱イオンモジュールを提供するものである。また、本発明の他の目的は、運転時の電圧を低下させて、消費電力の低減が可能な省電力型電気式脱イオン水製造装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】かかる実情において、本発明者らは、鋭意検討を行った結果、例えば、油中水滴型エマルジョンを重合させて得られる特定の連続気泡構造を有する多孔質体は、強度を保持し、且つ細孔容積や比表面積が格段に大きいため、電気式脱イオン水製造装置のイオン交換体に好適であること等を見出し、本発明を完成するに至った。

【 O O 1 2 】また、本発明は、前記多孔質イオン交換体を、枠体の一方の側に封着されたカチオン交換膜と他方の側に封着されたアニオン交換膜で形成される内部空間に充填してなるものであって、電気式脱イオン水製造装置に使用される脱イオンモジュールを提供するものである。この脱イオンモジュールによれば、イオン交換膜間の空間に充填される多孔質イオン交換体は、例えば、平

板状や円筒状に成形でき、且つ切断が容易なポリマー材を使用できるため、組み立てが容易で、簡易な構造とすることができる。また、本発明は、前記脱イオンモジュールを備える電気式脱イオン水製造装置を提供するものである。この電気式脱イオン水製造装置は、運転時の電圧を低下させて、消費電力の低減が可能な省電力型とすることができる。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の多孔質イオン交換体の基 本構造は、互いにつながっているマクロポアとマクロポ アの壁内に平均径が1~1000μm、好ましくは10 ~100 µmのメソポアを有する連続気泡構造である。 すなわち、連続気泡は、通常、平均径2~5000μm のマクロポアとマクロポアが重なり合り、この重なる部 分が共通の開口となるメソポアを有するもので、その大 部分がオープンポア構造のものである。オープンポア構 造は、水を流せば該マクロポアと該メソポアで形成され る気泡内が流路となる。マクロポアとマクロポアの重な りは、1個のマクロポアで1~12個、多くのものは3 ~10個である。メソポアの平均径が1μm 未満である と、これを水処理用に使用すると、通水時の圧力損失が 大きくなってしまい、一方、メソポアの平均径が100 Ο μm より大きいと、脱塩効率が低下してしまう点で好 ましくない。多孔質イオン交換体の構造が上記のような。 連続気泡構造となることにより、マクロポア群やメソポ ア群を均一に形成できると共に、特開平8-252579号公報 等に記載されるような粒子凝集型多孔質体に比べて、細 孔容積や比表面積を格段に大きくすることができる。こ のため、これを電気式脱イオン水製造装置のイオン交換 体として使用すると、脱塩効率が著しく向上し、非常に 有利である。

【0014】また、該多孔質イオン交換体は全細孔容積 が1~5 Oml/gである。全細孔容積が1ml/g未満である と、単位断面積当りの通水量が小さくなってしまい、処 理能力が低下してしまうため好ましくない。一方、全細 孔容積が50ml/gを超えると、例えば、ポリマー等の骨 格部分の占める割合が低下し、多孔質体の強度が著しく 低下してしまうため好ましくない。全細孔容積は従来の 多孔質イオン交換体では、せいぜいO. 1~O. 9ml/g であるから、それを越える従来には無い1~50ml/gの 高細孔容積、高比表面積のものが使用できる。また、該 多孔質イオン交換体は、その厚みが10mmの時、水透過 速度が100~100,0001/分·m²・MPa であることが好ま しい。水透過速度及び空孔率がこの範囲にあれば、これ を電気式脱イオン水製造装置のイオン交換体として使用 した場合、多孔質体の強度と脱塩効率を共に満足したも のとすることができる点で好ましい。連続気泡を形成す る骨格部分の材料は、架橋構造を有する有機ポリマー材 料を用い、該ポリマー材料はポリマー材料を構成する全 構成単位に対して、10~90モル%の架橋構造単位を

含むことが好ましい。架橋構造単位が10モル%未満で あると、機械的強度が不足するため好ましくなく、一 方、90モル%を越えると、イオン交換基の導入が困難 となり、イオン交換容量が低下してしまうため好ましく ない。該ポリマー材料の種類に特に制限はなく、例え ば、ポリスチレン、ポリ(αーメチルスチレン)、ポリ ビニルベンジルクロライド等のスチレン系ポリマー;ポ リエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン:ポリ 塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン等のポリ(ハ ロゲン化オレフィン);ポリアクリロニトリル等のニト リル系ポリマー、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリ ル酸エチル等の(メタ)アクリル系ポリマー:スチレン ージビニルベンゼン共重合体、ビニルベンジルクロライ ドージビニルベンゼン共重合体等が挙げられる。上記ポ リマーは、単独のモノマーを重合させて得られるホモポ リマーでも、複数のモノマーを重合させて得られるコポ リマーであってもよく、また、2種類以上のポリマーが ブレンドされたものであってもよい。これら有機ポリマ 一材料の中で、イオン交換基の導入の容易性と機械的強 度の髙さから、スチレンージビニルベンゼン共重合体や ビニルベンジルクロライドージビニルベンゼン共重合体 が好ましい材料として挙げられる。本発明の多孔質イオ ン交換体の連続気泡構造は、SEM写真で比較的容易に 観察できる。

【〇〇15】本発明の多孔質イオン交換体は、イオン交 換基が均一に分布され、イオン交換容量が O. 5mg当量 /g乾燥多孔質体以上、好ましくは2. Omg当量/g乾燥多 孔質体以上である。イオン交換容量がO. 5mg当量/g乾 燥多孔質体未満であると、脱塩効率が低下してしまうた め好ましくない。また、イオン交換基の分布が不均一で あると、多孔質イオン交換体内のイオンや電子移動が不 均一となり、電気抵抗の低減や捕捉イオンの濃縮室への 効率的な排出ができなくなるため好ましくない。なお、 「イオン交換基が均一に分布された」とは、イオン交換 基の分布が少なくともμm オーダーで均一であることを いう。イオン交換基の分布状況は、EPMAやSIMS 等を用いることで、比較的簡単に確認することができ る。多孔質イオン交換体に導入されるイオン交換基とし ては、カルボン酸基、イミノジ酢酸基、スルホン酸基、 リン酸基、リン酸エステル基等のカチオン交換基;四級 アンモニウム基、三級アミノ基、二級アミノ基、一級ア ミノ基、ポリエチレンイミン、第三スルホニウム基、ホ スホニウム基等のアニオン交換基:ベタイン、スルホベ タイン等の両性イオン交換基が挙げられる。

【0016】本発明の多孔質イオン交換体は、マクロポア群と、マクロポアとマクロポアが重なり合って生じる特定の開口のメソポア群が均一に存在する連続気泡構造を有するもので、従来の粒子凝集型多孔質体とは全く異なる新規な構造であり、多孔質イオン交換体の強度を保持しつつ、細孔容積や比表面積を格段に大きくすること

ができる。

【〇〇17】上記多孔質イオン交換体の製造方法としては、特に制限されず、イオン交換基を含む成分を一段階で多孔質体にする方法、イオン交換基を含まない成分により多孔質体を形成し、その後、イオン交換基を導入する方法などが挙げられる。多孔質イオン交換体の製造方法の一例を次に示す。すなわち、当該多孔質イオン交換体は、イオン交換基を含まない油溶性モノマー、界面活性剤、水及び必要に応じて重合開始剤とを混合し、油中水滴型エマルジョンを得、これを重合させて製造される。

【0018】イオン交換基を含まない油溶性モノマーと しては、カルボン酸基、スルホン酸基、四級アンモニウ ム基等のイオン交換基を含まず、水に対する溶解性が低 く、親油性のモノマーを指すものである。これらモノマ 一の具体例としては、スチレン、αーメチルスチレン、 ビニルトルエン、ビニルベンジルクロライド、ジビニル ベンゼン、エチレン、プロピレン、イソブテン、ブタジ エン、イソプレン、クロロプレン、塩化ビニル、臭化ビ ニル、塩化ビニリデン、テトラフルオロエチレン、アク リロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ピニル、アク リル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、 アクリル酸2-エチルヘキシル、トリメチロールプロパン トリアクリレート、ブタンジオールジアクリレート、メ タクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸 プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸2-エチル ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸 ベンジル、メタクリル酸グリシジル、エチレングリコー ルジメタクリレート等が挙げられる。これらモノマー は、1種単独又は2種以上を組み合わせて使用すること ができる。ただし、本発明においては、ジビニルペンゼ ン、エチレングリコールジメタクリレート等の架橋性モ ノマーを少なくとも油溶性モノマーの一成分として選択 し、その含有量を全油溶性モノマー中、10~90モル %、好ましくは15~80モル%とすることが、後のエ 程でイオン交換基量を多く導入するに際して必要な機械 的強度が得られる点で好ましい。

【0019】界面活性剤は、イオン交換基を含まない油溶性モノマーと水とを混合した際に、油中水滴型(W/O)エマルジョンを形成できるものであれば特に制限はなく、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノウート、ソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート等の非イオン界面活性剤:オレインをカリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、スルホコハク酸ジオクチルナトリウム等の陰イオン界面活性剤:ジステアリルジメチルアンモニウムクロライド等の陽イオン界面活性剤:ラウリルジメチルベタイン等の両

【0020】重合開始剤としては、熱及び光照射により ラジカルを発生する化合物が好適に用いられる。重合開始剤は水溶性であっても油溶性であってもよく、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスシクロへキサンニトリル、アゾビスシクロへキサンカルボニトリル、過酸化ベンゾイル、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化水素ー塩化第一鉄、過硫酸ナトリウムー酸性亜硫酸ナトリウム、テトラメチルチウラムジスルフィド等が挙げられる。ただし、場合によっては、重合開始剤を添加しなくても加熱のみや光照射のみで重合が進行する系もあるため、そのような系では重合開始剤の添加は不要である。

【0021】イオン交換基を含まない油溶性モノマー、 界面活性剤、水及び重合開始剤とを混合し、油中水滴型 エマルジョンを形成させる際の混合方法としては、特に 制限はなく、各成分を一括して一度に混合する方法、 溶性モノマー、界面活性剤及び油溶性重合開始剤である水溶性重合開始剤である水溶性重合開始剤である水溶性の とを別々に均一溶解させた後、それぞれの成分を混合も とを別々に均一溶解させた後、それぞれの成分を混合も あの混合装置についても特に制限はなく、通常のミキサーやホモジナイザー、高圧ホモジナイザー等を用いなも とができ、目的のエマルジョン粒径を得るのに適切なま で選択すればよい。また、混合条件についても特に制 限はなく、目的のエマルジョン粒径を得ることができ 置を選択すればよい。また、混合条件についても特に制 限はなく、目的のエマルジョン粒径を得ることができる。

【0022】このようにして得られた油中水滴型エマルジョンを重合させる重合条件は、モノマーの種類、開始 削系により様々な条件が選択できる。例えば、重合開始 削としてアゾビスイソブチロニトリル、過酸化ペンゾイル、過硫酸カリウム等を用いたときには、不活性雰囲気下の密封容器内において、30~100℃で1~48時間、加熱重合させればよく、開始剤として過酸化水素~塩化第一鉄、過硫酸ナトリウム一酸性亜硫酸ナトリウム等を用いたときには、不活性雰囲気下の密封容器内にお

いて、0~30℃で1~48時間重合させればよい。重合終了後、内容物を取り出し、イソプロパノール等の溶剤でソックスレー抽出し、未反応モノマーと残留界面活性剤を除去して多孔質体を得る。

【0023】重合工程で得られた多孔質体にイオン交換 基を導入する方法としては、特に制限はなく、高分子反 応やグラフト重合等の公知の方法を用いることができ る。例えば、スルホン酸基を導入する方法としては、多 孔質体がスチレンージビニルベンゼン共重合体等であれ ばクロロ硫酸や濃硫酸、発煙硫酸を用いてスルホン化す る方法;多孔質体にラジカル開始基や連鎖移動基を導入 し、スチレンスルホン酸ナトリウムやアクリルアミドー 2-メチルプロパンスルホン酸をグラフト重合する方 法:同様にグリシジルメタクリレートをグラフト重合し た後、官能基変換によりスルホン酸基を導入する方法等 が挙げられる。また、四級アンモニウム基を導入する方 法としては、多孔質体がスチレンージビニルベンゼン共 重合体等であればクロロメチルメチルエーテル等により クロロメチル基を導入した後、三級アミンと反応させ導 入する方法:多孔質体をクロロメチルスチレンとジビニ ルベンゼンの共重合により製造し、三級アミンと反応さ せ導入する方法:多孔質体にラジカル開始基や連鎖移動 基を導入し、N、N、Nートリメチルアンモニウムエチ ルアクリレートやN、N、N-トリメチルアンモニウム プロピルアクリルアミドをグラフト重合する方法:同様 にグリシジルメタクリレートをグラフト重合した後、官 能基変換により四級アンモニウム基を導入する方法等が 挙げられる。また、ベタインを導入する方法としては、 上記の方法により多孔質体に三級アミンを導入した後、 モノヨード酢酸を反応させ導入する方法等が挙げられ る。なお、導入するイオン交換基としては、カルボン酸 基、イミノジ酢酸基、スルホン酸基、リン酸基、リン酸 エステル基等のカチオン交換基:四級アンモニウム基、 三級アミノ基、二級アミノ基、一級アミノ基、ポリエチ レンイミン、第三スルホニウム基、ホスホニウム基等の アニオン交換基;ベタイン、スルホベタイン等の両性イ オン交換基が挙げられる。

【0024】本発明の電気式脱イオン水製造装置に使用される脱イオンモジュールとしては、例えば、図1に示すように、板状に成形した多孔質イオン交換体100を、枠体103の一方の側に封着されたカチオン交換膜101と、他方の側に封着されたアニオン交換膜102で形成される内部空間104に充填してなる脱イオンモジュール10A、あるいは、図2に示すように、板状に成形した多孔質イオン交換体100aを枠体103bの間に封着された中間イオン交換に105とで形成される第1内部空間104aに充填し、更に、板状に成形した多孔質イオン交換体100bを中間イオン交換膜105と枠体103bの他方の側に

封着されたアニオン交換膜102とで形成される第2内部空間104bに充填してなる脱イオンモジュール10 Bが挙げられる。すなわち、本発明の多孔質イオン交換体の脱イオンモジュールへの充填の態様は、脱イオン水製造の目的を達成するものであれば特に制限されるものではないが、従来の脱イオンモジュールにおけるイオン交換体を本発明の多孔質イオン交換体で置き換えた充填態様を採ることができる。また、本発明の脱イオンモジュールは、枠体を使用することなく、イオン交換膜と多孔質イオン交換体を予め、接着剤などを用いて張り合わせて作製することができ、電気式脱イオン水製造装置の組み立て作業を簡便化することができる。

【〇〇25】本発明の電気式脱イオン水製造装置として は、上記脱イオンモジュールを備えるものであり、多孔 質イオン交換体に捕捉せしめた不純物イオンを電気的に 排除して、脱イオン水を製造する装置であれば、特に制 限されず、平板型、円筒型及びスパイラル型の電気式脱 イオン水製造装置が挙げられる。平板型電気式脱イオン 水製造装置は、例えば、カチオン交換膜とアニオン交換 膜との間に多孔質イオン交換体を充填してなる脱塩室 と、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩 室の両側に設けられた濃縮室と、これらの両側に配置さ れた陽極と、陰極とを備えてなる装置、カチオン交換膜 と、カチオン交換膜とアニオン交換膜の間に配置される 中間イオン交換膜とで形成される第1小脱塩室、及び該 中間イオン交換膜とアニオン交換膜とで形成される第2 小脱塩室に、それぞれ多孔質イオン交換体を充填してな る脱塩室と、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介 して脱塩室の両側に設けられた濃縮室と、これらの両側 に配置された陽極と、陰極とを備えてなる装置、が使用 できる。

【0026】以下、本発明の実施の形態における電気式 脱イオン水製造装置を図3を参照して説明する。図3に おいて、1は脱塩室、2は濃縮室で、これらの脱塩室1 を構成するには前述の様なモジュール品として作製され る。本例では、両性イオン交換基を導入した多孔質両性 イオン交換体100cをアニオン交換膜102とカチオ ン交換膜101で挟むように充填して脱イオンモジュー ル10Aとする。脱イオンモジュール10Aは離間して 複数並設される。各脱イオンモジュール10A、10A 間には枠状に形成されたゴムパッキン等の水密部材から なるスペーサー(不図示)が介在され、このようにして 形成される空間部を濃縮室2として構成する。脱塩室1 と濃縮室2との交互配列体の両側部に陽極110と陰極 109を配置し、陽極110、陰極109の近傍にそれ ぞれ仕切り膜113、114を設け、該仕切り膜113 と陽極110との間の空間部を陽極室111とし、該仕 切り膜114と陰極109との間の空間部を陰極室11 2として構成する。図3では図示の関係で多孔質両性イ オン交換体100cとその両側に位置するアニオン交換

膜102、カチオン交換膜101とは離間しているようになっているが、実際は多孔質両性イオン交換体100 cとアニオン交換膜102、カチオン交換膜101とは密着している。なお、後述する図4~図7においても脱塩室を形成する多孔質イオン交換体とイオン交換膜は密着している。

【0027】図3の電気式脱イオン水製造装置は、次のように操作される。先ず、被処理水を脱塩室1内に流入し、濃縮水を濃縮室2内に流入し、且つ陽極室111、陰極室112にそれぞれ電極水を流入する。濃縮水としては、通常、脱塩室1に供給する被処理水と同じものが使用される。一方、陽極110、陰極109間に電圧を印加し、被処理水、濃縮水の流れ方向に対して直角方向に直流電流を通じる。脱塩室1内に流入された被処理水は、多孔質イオン交換体のマクロポア及びメソポアからなる連続気泡構造内を流通する際、該連続気泡構造内に導入されたイオン交換基にイオンが捕捉され、該イオンはイオン交換膜101、102を通って濃縮室2内に排除される。

【0028】他の実施の形態の電気式脱イオン水製造装 置を図4~図7に示す。脱イオンモジュールの数は処理 能力などの使用条件によって適宜に決定されるもので、 図4~図7では、図面の簡素化を目的に脱イオンモジュ 一ルは2個で表示する。また、同一構成要素には同一符 号を付して、その説明を省略し、異なる点について主に 説明する。図4において、図3と異なる点は、脱イオン モジュールを構成する多孔質イオン交換体の種類を変え た点にあり、図4の装置で使用される脱イオンモジュー ル10Aは、両性イオン交換基を導入した多孔質両性イ オン交換体100c、カチオン交換基を導入した多孔質 カチオン交換体100d、アニオン交換基を導入した多 **孔質アニオン交換体100e、をそれぞれ小ブロック状** に製作し、被処理水の流入側より多孔質両性イオン交換 体100c、多孔質カチオン交換体100d、多孔質ア ニオン交換体100e、多孔質カチオン交換体100 d、多孔質アニオン交換体 100eとなるように積層 し、これをアニオン交換膜102とカチオン交換膜10 1で挟むように構成した態様である。

【0029】図5において、図3と異なる点は、脱イオンモジュールを構成する多孔質イオン交換体の種類を変えた点にあり、図5の装置で使用される脱イオンモジュール10Aは、多孔質カチオン交換体100dと多孔質アニオン交換体100eを、互いに多孔質イオン交換体側を当接させ、該当接面とは反対側の両側をアニオン交換膜102とカチオン交換膜101で挟むように構成した態様である。

【0030】図6において、図3と異なる点は、脱イオンモジュールを構成する多孔質イオン交換体の種類を変えた点及び2個の脱イオンモジュールを直列に接続し、一方の脱イオンモジュールの流出水を他方の脱イオンモ

ジュールの被処理水とした点にある。すなわち、図6の装置で使用される脱イオンモジュール10Aは、カチオン交換基を導入した多孔質カチオン交換体100dとアニオン交換基を導入した多孔質アニオン交換体100eをそれぞれアニオン交換膜102とカチオン交換膜101で挟むように充填して、それぞれを脱カチオンモジュール10A1と脱アニオンモジュール10A2とし、脱アニオンモジュール10A1の被処理水としたものである。

【 O O 3 1 】 図 3 ~ 図 6 の装置で使用される脱イオンモジュールはいずれも、図 1 に示す脱イオンモジュール 1 O A が使用できる。

【0032】一方、図7の装置で使用される脱イオンモ ジュールは、図2に示す脱イオンモジュール10日が使 用できる。すなわち、図7の装置は、一側のカチオン交 換膜101、他側のアニオン交換膜102及びカチオン 交換膜101とアニオン交換膜102の間に位置する中・ 間イオン交換膜105で区画される2つの小脱塩室1 a、1bのカチオン交換膜101側の小脱塩室1bに多 孔質両性イオン交換体、もしくは多孔質アニオン交換体 と多孔質カチオン交換体の積層体100fを充填し、ア ニオン交換膜102側の小脱塩室1aに多孔質アニオン 交換体100 e を充填して脱塩室1を構成し、カチオン 交換膜101、アニオン交換膜102を介して脱塩室の 両側に濃縮室2を設け、これらの脱塩室1及び濃縮室2 を陽極110と陰極109の間に配置して構成される。 本例では、中間イオン交換膜105はアニオン交換膜を 使用している。

【〇〇33】図7の電気式脱イオン水製造装置は、次の ように操作される。先ず、被処理水を小脱塩室1a内に 流入し、次いで、小脱塩室1aの流出水を隣接する他の 小脱塩室16に流入し、濃縮水を濃縮室2内に流入し、 且つ陽極室111、陰極室112にそれぞれ電極水を流 入する。濃縮水としては、通常、小脱塩室1aに供給す る被処理水と同じものが使用される。一方、陽極11 〇、陰極109間に電圧を印加し、被処理水、濃縮水の 流れ方向に対して直角方向に直流電流を通じる。小脱塩 室1a内に流入された被処理水は、多孔質アニオン交換 体100eのマクロポア及びメソポアからなる連続気泡 構造内を流通する際、該連続気泡構造内に導入されたイ オン交換基にイオンが捕捉され、除去される。更に、小 脱塩室1aの流出水は多孔質両性イオン交換体、もしく は多孔質アニオン交換体と多孔質カチオン交換体の積層 体1006のマクロポア及びメソポアからなる連続気泡 構造内を流通する際、該連続気泡構造内に導入されたイ オン交換基にイオンが捕捉され、除去される。濃縮水は 各濃縮室を上昇し、カチオン交換膜101及びアニオン 交換膜102を介して移動してくる不純物イオンを受取 り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として系外へ排出さ れる。

[0034]

【実施例】次に、実施例を挙げて、本発明を更に具体的 に説明するが、これは単に例示であって、本発明を制限 するものではない。

実施例1

(多孔質カチオン交換体の製造)スチレン27.7g、 ジビニルペンゼン6.9g、アゾビスイソブチロニトリ ル0. 14g及びソルビタンモノオレエート3.8gを 混合し、均一に溶解させた。次に、当該スチレン/ジビ ニルベンゼン/アゾビスイソブチロニトリル/ソルビタ ンモノオレエート混合物を450mlの純水に添加し、ホ モジナイザーを用いて2万回転/分で2分間攪拌し、油 中水滴型エマルジョンを得た。乳化終了後、油中水滴型 エマルジョンをステンレス製のオートクレーブに移し、 窒素で十分置換した後密封し、静置下60℃で24時間 重合させた。重合終了後、内容物を取り出し、イソプロ パノールで18時間ソックスレー抽出し、未反応モノマ ーとソルビタンモノオレエートを除去した後、40℃で 一昼夜減圧乾燥した。このようにして得られたスチレン /ジビニルベンゼン共重合体よりなる架橋成分を14モ ル%含有した多孔質体5gを分取し、テトラクロロエタ ン500gを加え、60℃で30分加熱した後、室温ま で冷却し、クロロ硫酸25gを徐々に加え、室温で24 時間反応させた。その後、酢酸を加え、多量の水中に反 応物を投入し、水洗、乾燥して多孔質カチオン交換体を 得た。この多孔質体のイオン交換容量は、乾燥多孔質体 換算で4. Omg当量/gであり、EPMAを用いた硫黄 原子のマッピングにより、スルホン酸基が多孔質体に均 ーに導入されていることを確認した。また、図8に示す SEM観察の結果、この多孔質体の内部構造は、連続気 泡構造を有しており、平均径30μm のマクロポアの大 部分が重なり合い、マクロポアとマクロポアの重なりで 形成されるメソポアの直径の平均値は5 µm 、全細孔容 積は、10.1ml/gであった。また、上記多孔質体を1 Ommの厚みに切り出し、水透過速度を測定したところ、 14,0001/分·m²・MPa であり、良好な水透過性を示し

【0035】実施例2

(多孔質アニオン交換体の製造)スチレン27.7gの代わりに、p-クロロメチルスチレン18.0gを用い、ジビニルベンゼン17.3g、アゾビスイソブチロニトリル0.26gとした以外、実施例1と同様の油中水滴型エマルジョンの重合を行い、pークロロメチルスチレン/ジビニルベンゼン共重合体よりなる架橋成分を50モル%含有した多孔質体を製造した。この多孔質体5gを分取し、ジオキサン500gを加え80℃で30分加熱した後、室温まで冷却し、トリメチルアミン(30%)水溶液65gを徐々に加え、50℃で3時間反応させた後、室温で一昼夜放置した。反応終了後、多孔質体を取り出し、アセトンで洗浄後水洗し、乾燥して多孔

質アニオン交換体を得た。この多孔質体のイオン交換容量は、乾燥多孔質体換算で2.5mg当量 $\angle g$ であり、SIMSにより、トリメチルアンモニウム基が多孔質体に均一に導入されていることを確認した。また、SEM観察の結果、この多孔質体の内部構造は、連続気泡構造を有しており、平均径30 μm のマクロポアの大部分が重なり合い、マクロポアとマクロポアの重なりで形成されるメソポアの直径の平均値は $4\mu m$ 、全細孔容積は9.9m1/gであった。また、上記多孔質体を10mmの厚みに切り出し、水透過速度を測定したところ、 $12,0001/分・m^2 \cdot MPa$ であり、良好な水透過性を示した。

【0036】比較例1

アゾビスイソブチロニトリル O. 14gに代えて、過硫酸カリウム O. 60g を用いたこと、及びソルビタンモノオレエートの使用量 3. 8g を 15. 5g に変更した以外、実施例 1 と同様の操作を行い、多孔質カチオン交換体を得た。得られた多孔質体は、イオン交換容量が乾燥多孔質体換算で 4. 0mg 当量/g、全細孔容積が 9. 2ml/gであったが、メソポアの直径の平均値が 0. $2\mu m$ と小さく、実施例 1 と同様に水透過速度を測定したところ、 $40l/分・m^2 \cdot MPa$ であった。

【0037】実施例3

(脱イオンモジュールの作製)実施例1及び2で得られた多孔質カチオン交換体、多孔質アニオン交換体及び多孔質両性イオン交換体を縦100mm、横100mm、幅8mの大きさに切断して、それぞれ5個の小ブロックとした。すなわち、多孔質両性イオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100c、多孔質アニオン交換体100cとなるように積層し、これをアニオン交換膜102とカチオン交換膜101で挟むように充填して、図4の装置で使用されるような脱イオンモジュールを得た。

【0038】実施例4

(電気式脱イオン水製造装置の製造及び運転) 得られた脱イオンモジュールを脱塩室として電気式脱イオン水製造装置を製造した。電気式脱イオン水製造装置は、脱塩室1室、陽極室1室、陰極室1室よりなる装置とした。脱塩室と陽極室との間、脱塩室と陰極室との間にはそれぞれスペーサを挿入して濃縮室を形成した。この電気式脱イオン水製造装置に、市水を逆浸透膜で処理した導電率が3.6μS/cmの水を被処理水として供給し、運転した。電気式脱イオン水製造装置の操作電流0.40Aで、比抵抗5.0MΩcmの処理水を得た。このときの、操作電圧は20Vであった。

【0039】比較例2

連続気泡構造の多孔質イオン交換体に代えて、アンバー

ライト120日とアンバーライト402日Lを当量混合したものを用いた以外は、実施例4と同様の条件で電気式脱イオン水製造装置を運転した。この電気式脱イオン水製造装置に、市水を逆浸透膜で処理した導電率が3.6 μ S/cmの水を被処理水として供給し、運転した。電気式脱イオン水製造装置の操作電流0.40Aで、比抵抗5.0 μ S/cmの処理水を得た。このときの、操作電圧は30 ν であった。

【0040】実施例4は比較例2と対比して、イオン交換体を多孔質イオン交換体とすることにより、電気式脱イオン水製造装置の操作電圧を低減し消費電力を節約できることが確認できた。また、脱イオンモジュールの作製は、比較例1では湿潤状態でイオン交換樹脂を均一に充填しなければならず、製作に苦労した反面、実施例3及び4ではイオン交換樹脂の均一充填という作業はなく、容易であった。

[0041]

【発明の効果】本発明の多孔質イオン交換体は、特定の連続気泡構造を有したイオン交換体であり、従来の粒子凝集型多孔質体とは全く異なる新規な構造である。特に、該多孔質体は強度を保持しつつ、細孔容積や比表面積を格段に大きくすることができる。本発明の脱イオンモジュールによれば、イオン交換膜間の空間に充填される多孔質イオン交換体は、例えば、平板状や円筒状に成形でき、且つ切断が容易なポリマー材を使用できるため、組み立てが容易で、簡易な構造とすることができる。また、本発明の電気式脱イオン水製造装置は、脱塩効率が高いため、運転時の電圧を低下させて、消費電力の低減が可能な省電力型とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

【図1】本発明の脱イオンモジュールを説明する模式図である。

【図2】本発明の他の脱イオンモジュールを説明する模式図である。

【図3】本発明の電気式脱イオン水製造装置を説明する 模式図である。

【図4】本発明の他の電気式脱イオン水製造装置を説明 する模式図である。

【図5】本発明の他の電気式脱イオン水製造装置を説明 する模式図である。

【図6】本発明の他の電気式脱イオン水製造装置を説明 する模式図である。

【図7】本発明の他の電気式脱イオン水製造装置を説明 する模式図である。

【図8】実施例で得られた多孔質イオン交換体のSEM 写真である。

【符号の説明】

1 脱塩室

2 濃縮室

10A、10A₁、10A₂、10B 脱イオン モジュール

100、100a、100b 多孔質イオン交換体

100c 多孔質両性イオン交換体

100d 多孔質カチオン交換体

100e 多孔質アニオン交換体

100f 多孔質カチオン交換体と多孔質アニオン

[図4]

交換体の積層体もしくは多孔質両性イオン交換体

101 カチオン交換膜

102 アニオン交換膜

103、103a、103b 枠体

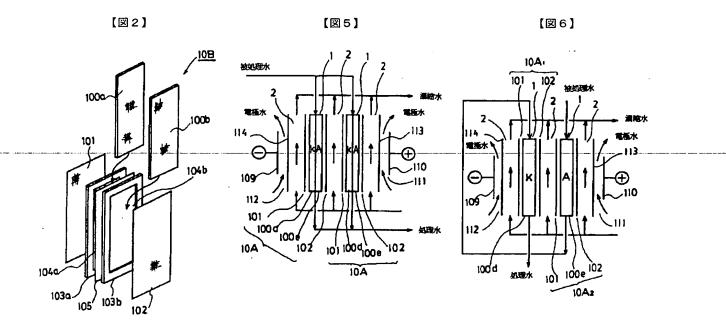
104、104a、104b 空間部

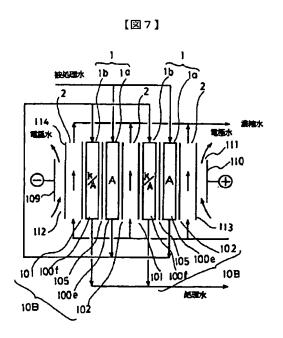
105 中間イオン交換膜

109 陰極

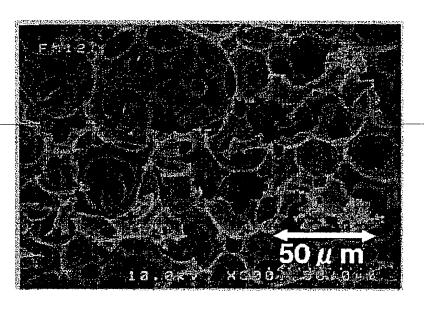
110 陽極

[図3]





【図8】



フロントページの続き

(72) 発明者 田村 真紀夫 東京都江東区新砂1丁目2番8号 オルガ ノ株式会社内 Fターム(参考) 4D006 GA17 HA44 HA47 HA93 JA30Z KE30R MA03 MA13 MA14 MA15 MA22 MA24 MB07 MC24X MC26X MC74X MC78X PA01 PB06 PB25 PB26 PC01 PC11 PC17 PC31 PC42 4D061 DA03 DB18 EA09 EB13 EB19 EB22

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.